

## 透過電子顕微鏡用SiN window chip

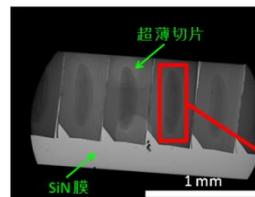
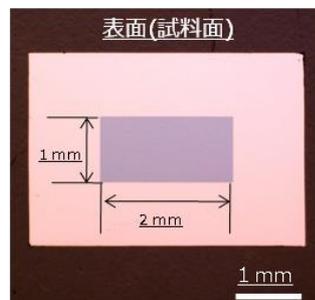
## ■ 概要

**特徴** MEMS技術により作製された、高強度のSiN(窒化シリコン)支持膜付き試料台です。バイオ試料などの透過電子顕微鏡観察において、ミリメートルサイズの連続した広視野を観察することができます。

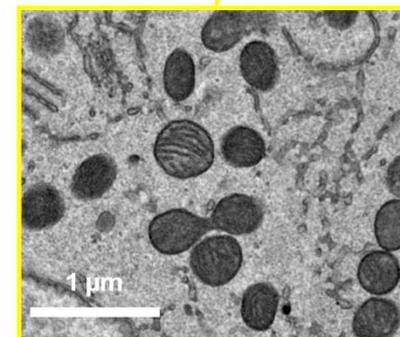
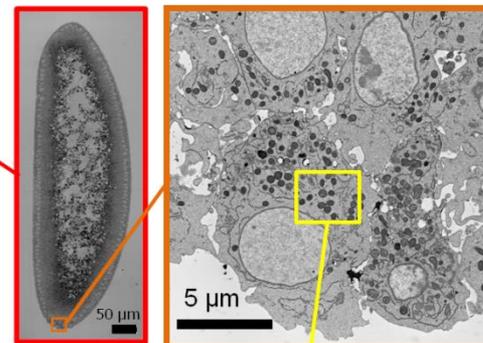
**関わり方** 共同研究 SiN window chip

**開発時期** 平成29～30年

**担当** 電子情報システム部



SiN window chipの低倍TEM像



試料：ショウジョウバエの初期胚  
撮影枚数：縦23枚 × 横8枚 (184枚)  
撮影装置：JEM-1400Flash  
(加速電圧：120 kV)

## 【参考文献】

Y. Konyuba et al., *Microscopy* **67** 367-370

## ■ 企業情報

**企業名** 日本電子株式会社  
**所在地** 東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号  
**TEL** 042-543-1111  
**URL** <http://www.jeol.co.jp>  
**事業内容** 理化学計測機器、半導体関連機器、産業機器、医用機器の製造・販売・研究開発等

## ■ 支援技術の概要



レーザー描画

SiN window chipは、厚さ数十nmのSiN自立薄膜を有しています。レーザー描画によるレジストへの露光や異方性エッチングといったMEMS技術により実現しました。また、三次元表面構造解析顕微鏡などの測定装置により形状の評価も行いました。